

マテリアル先端リサーチインフラ (ARIM) 事業共用機器の使用料設定について
(旧ナノテクノロジープラットフォーム事業 (微細加工) 分)

令和8年10月1日適用

I 1時間あたりの使用料

単位: 円、消費税込み [] 内は研究成果非公開使用料 (内数)

番号	共用機器種別	利用報告書	データ登録	依頼測定時 (技術代行)			直接測定時 (技術補助)			直接測定時		
				学内者	学外者		学内者	学外者		学内者	学外者	
					非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人
NU-201	イオン注入装置 日新電機社製 NH-20SR-WMH	公開	可	2,900	5,700	7,200	2,900	4,100	5,400	2,900	2,900	4,000
			不可		8,100	10,200		5,800	7,600		4,000	5,600
		非公開	不可		18,000 [9,900]	22,600 [12,400]		13,000 [7,200]	17,000 [9,400]		9,000 [5,000]	12,500 [6,900]
NU-202	急速加熱処理装置 AG Associates社製 Heatpulse610	公開	可	2,000	4,900	5,800	2,000	3,300	4,000	2,000	2,100	2,600
			不可		7,000	8,200		4,700	5,600		2,900	3,600
		非公開	不可		15,900 [8,900]	18,700 [10,500]		10,900 [6,200]	13,100 [7,500]		6,900 [4,000]	8,600 [5,000]
NU-204	原子間力顕微鏡 Bruker社製 AXS Dimension3100	公開	可	1,000	4,100	4,900	1,000	2,500	3,100	1,000	1,200	1,700
			不可		5,800	6,900		3,500	4,300		1,700	2,300
		非公開	不可		13,900 [8,100]	16,400 [9,500]		8,900 [5,400]	10,800 [6,500]		4,900 [3,200]	6,300 [4,000]
NU-205	3元マグネトロンパツタ装置 島津製作所製 HSR-522	公開	可	1,600	4,600	5,600	1,600	3,000	3,800	1,600	1,700	2,400
			不可		6,500	8,000		4,200	5,400		2,400	3,400
		非公開	不可		15,300 [8,800]	18,700 [10,700]		10,300 [6,100]	13,100 [7,700]		6,300 [3,900]	8,600 [5,200]
NU-206	電子線露光装置 日本電子社製 JBX6300FS	公開	可	4,100	6,600	8,400	4,100	4,900	6,600	4,100	4,100	5,200
			不可		9,300	12,000		7,000	9,400		5,200	7,400
		非公開	不可		23,300 [14,000]	29,600 [17,600]		18,300 [11,300]	24,000 [14,600]		14,300 [9,100]	19,500 [12,100]
NU-207	X線光電子分光装置 VG社製 ESCALAB250	公開	可	2,400	5,300	6,400	2,400	3,700	4,600	2,400	2,400	3,200
			不可		7,500	9,100		5,200	6,500		3,400	4,500
		非公開	不可		17,900 [10,400]	21,500 [12,400]		12,900 [7,700]	15,900 [9,400]		8,900 [5,500]	11,400 [6,900]
NU-208	マスクアライナー式 (1)Suss MicroTec AG製 MA-6	公開	可	2,600	5,600	6,700	2,600	4,000	4,900	2,600	2,700	3,500
			不可		7,900	9,500		5,600	6,900		3,800	4,900
		非公開	不可		18,500 [10,600]	22,100 [12,600]		13,500 [7,900]	16,500 [9,600]		9,500 [5,700]	12,000 [7,100]
NU-209	ICPエッチング装置一式 サムコ製 RIE-800	公開	可	10,700	12,100	14,000	10,700	10,700	12,200	10,700	10,700	10,800
			不可		17,200	20,000		14,900	17,400		13,100	15,400
		非公開	不可		43,800 [26,600]	50,800 [30,800]		38,800 [23,900]	45,200 [27,800]		34,800 [21,700]	40,700 [25,300]
NU-210	ダイシングソー装置 サムコ製 DAD522	公開	可	2,800	5,600	6,600	2,800	4,000	4,700	2,800	2,800	3,300
			不可		8,000	9,300		5,700	6,700		3,900	4,700
		非公開	不可		19,200 [11,200]	22,300 [13,000]		14,200 [8,500]	16,700 [10,000]		10,200 [6,300]	12,200 [7,500]
NU-211	フェムト秒レーザー加工分析システム UFL-Hybrid	公開	可	3,800	6,400	8,000	3,800	4,800	6,200	3,800	3,800	4,800
			不可		9,100	11,400		6,800	8,800		5,000	6,800
		非公開	不可		20,100 [11,000]	25,100 [13,700]		15,100 [8,300]	19,500 [10,700]		11,100 [6,100]	15,000 [8,200]
NU-213	8元マグネトロンパツタ装置	公開	可	1,700	4,700	5,900	1,700	3,100	4,000	1,700	1,900	2,600
			不可		6,700	8,300		4,400	5,700		2,600	3,700
		非公開	不可		14,800 [8,100]	18,300 [10,000]		9,800 [5,400]	12,700 [7,000]		5,800 [3,200]	8,200 [4,500]
NU-214	8元MBE装置	公開	可	2,900	5,700	6,900	2,900	4,100	5,100	2,900	2,900	3,700
			不可		8,100	9,800		5,800	7,200		4,000	5,200
		非公開	不可		17,900 [9,800]	21,600 [11,800]		12,900 [7,100]	16,000 [8,800]		8,900 [4,900]	11,500 [6,300]
NU-216	スプレーコーター式 サンメイ製 DC110	公開	可	1,800	5,000	5,800	1,800	3,400	4,000	1,800	2,100	2,600
			不可		7,100	8,200		4,800	5,600		3,000	3,600
		非公開	不可		15,600 [8,500]	18,100 [9,900]		10,600 [5,800]	12,500 [6,900]		6,600 [3,600]	8,000 [4,400]
NU-218	電気炉 光洋リンドバーク社製 MODEL272-2	公開	可	2,700	5,500	6,600	2,700	3,900	4,700	2,700	2,700	3,300
			不可		7,800	9,300		5,500	6,700		3,700	4,700
		非公開	不可		17,200 [9,400]	20,500 [11,200]		12,200 [6,700]	14,900 [8,200]		8,200 [4,500]	10,400 [5,700]

マテリアル先端リサーチインフラ(ARIM)事業共用機器の使用料設定について
(旧ナノテクノロジープラットフォーム事業(微細加工)分)

令和8年10月1日適用

I 1時間あたりの使用料

単位:円、消費税込み 〔〕内は研究成果非公開使用料(内数)

番号	共用機器種別	利用報告書	データ登録	依頼測定時(技術代行)			直接測定時(技術補助)			直接測定時		
				学内者	学外者		学内者	学外者		学内者	学外者	
					非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人
NU-219	酸化・拡散炉 光洋リンドバーク社製 MODEL270-M100	公開	可	1,900	5,100	6,300	1,900	3,500	4,500	1,900	2,200	3,100
			不可		7,200	9,000		4,900	6,400		3,100	4,400
		非公開	不可		15,900 〔8,700〕	19,800 〔10,800〕		10,900 〔6,000〕	14,200 〔7,800〕		6,900 〔3,800〕	9,700 〔5,300〕
NU-220	小型微細形状測定機一式 小坂研究所製 ET200	公開	可	1,700	4,900	5,600	1,700	3,300	3,800	1,700	2,000	2,400
			不可		6,900	8,000		4,600	5,400		2,800	3,400
		非公開	不可		15,200 〔8,300〕	17,600 〔9,600〕		10,200 〔5,600〕	12,000 〔6,600〕		6,200 〔3,400〕	7,500 〔4,100〕
NU-221	プラズマCVD装置 サムコ製 PD-240	公開	可	1,700	4,700	5,800	1,700	3,100	4,000	1,700	1,900	2,600
			不可		6,700	8,200		4,400	5,600		2,600	3,600
		非公開	不可		14,800 〔8,100〕	18,100 〔9,900〕		9,800 〔5,400〕	12,500 〔6,900〕		5,800 〔3,200〕	8,000 〔4,400〕
NU-222	レーザー描画装置 Heidelberg Instruments社製 DWL66FS	公開	可	1,600	4,600	5,600	1,600	3,000	3,800	1,600	1,700	2,400
			不可		6,500	7,900		4,200	5,300		2,400	3,300
		非公開	不可		14,900 〔8,400〕	18,000 〔10,100〕		9,900 〔5,700〕	12,400 〔7,100〕		5,900 〔3,500〕	7,900 〔4,600〕
NU-223	フォトリソグラフィ装置 ウシオ電機社製 マルチライトML251A/B、 共和理研社製 スピンナーK-359SD-1	公開	可	1,300	4,300	5,400	1,300	2,700	3,500	1,300	1,400	2,100
			不可		6,100	7,600		3,800	5,000		2,000	3,000
		非公開	不可		13,800 〔7,700〕	17,100 〔9,500〕		8,800 〔5,000〕	11,500 〔6,500〕		4,800 〔2,800〕	7,000 〔4,000〕
NU-224	電子ビーム蒸着装置 アルバック社製 EBX-10D	公開	可	1,700	4,700	5,600	1,700	3,100	3,800	1,700	1,800	2,400
			不可		6,600	7,900		4,300	5,300		2,500	3,300
		非公開	不可		14,900 〔8,300〕	17,900 〔10,000〕		9,900 〔5,600〕	12,300 〔7,000〕		5,900 〔3,400〕	7,800 〔4,500〕
NU-225	ICPエッチング装置 アルバック社製 CE-300I ()内は1回あたりの料金 ※試料を高真空中に保持し作製(約8時間)する場合	公開	可	2,400 (28,500)	5,200 (61,900)	6,300 (72,100)	2,400 (28,500)	3,600 (43,100)	4,500 (50,800)	2,400 (28,500)	2,400 (28,500)	3,100 (33,800)
			不可		7,400 (88,300)	8,900 (102,900)		5,100 (61,500)	6,300 (72,500)		3,300 (40,000)	4,300 (48,200)
		非公開	不可		17,000 〔9,600〕	20,300 〔11,400〕		12,000 〔6,900〕	14,700 〔8,400〕		8,000 〔4,700〕	10,200 〔5,900〕
					(203,400)	(236,100)		(144,100)	(169,000)		(96,600)	(115,300)
					((115,100))	((133,200))		((82,600))	((96,500))		((56,600))	((67,100))
NU-226	RIEエッチング装置 サムコ社製 RIE-10NR	公開	可	1,400	4,400	5,100	1,400	2,800	3,300	1,400	1,500	1,900
			不可		6,200	7,200		3,900	4,600		2,100	2,600
		非公開	不可		14,300 〔8,100〕	16,600 〔9,400〕		9,300 〔5,400〕	11,000 〔6,400〕		5,300 〔3,200〕	6,500 〔3,900〕
NU-227	走査型電子顕微鏡 日立ハイテクフィールディング社製 S5200	公開	可	1,900	4,800	5,900	1,900	3,200	4,100	1,900	1,900	2,700
			不可		6,800	8,400		4,500	5,800		2,700	3,800
		非公開	不可		16,000 〔9,200〕	19,500 〔11,100〕		11,000 〔6,500〕	13,900 〔8,100〕		7,000 〔4,300〕	9,400 〔5,600〕
NU-228	走査型電子顕微鏡 日立ハイテクフィールディング社製 S4300	公開	可	2,100	5,000	6,000	2,100	3,400	4,200	2,100	2,100	2,800
			不可		7,100	8,500		4,800	5,900		3,000	3,900
		非公開	不可		15,600 〔8,500〕	18,700 〔10,200〕		10,600 〔5,800〕	13,100 〔7,200〕		6,600 〔3,600〕	8,600 〔4,700〕
NU-231	マスクレス露光装置 ナノシステムソリューションズ製 DL-1000	公開	可	2,800	5,900	6,900	2,800	4,200	5,100	2,800	3,000	3,600
			不可		8,300	9,800		6,000	7,200		4,200	5,100
		非公開	不可		18,400 〔10,100〕	21,700 〔11,900〕		13,300 〔7,300〕	16,000 〔8,800〕		9,300 〔5,100〕	11,300 〔6,200〕
NU-232	原子層堆積装置 サムコ製 AD-100LE	公開	可	4,400	7,000	8,200	4,400	5,400	6,400	4,400	4,400	5,000
			不可		9,900	11,700		7,600	9,100		5,800	7,100
		非公開	不可		21,800 〔11,900〕	25,800 〔14,100〕		16,800 〔9,200〕	20,200 〔11,100〕		12,800 〔7,000〕	15,700 〔8,600〕
NU-233	蛍光りん光分光光度計 堀場製作所製 Fluoromax-4P	公開	可	200	3,800	4,400	200	2,100	2,600	200	900	1,200
			不可		5,300	6,200		3,000	3,600		1,200	1,600
		非公開	不可		11,700 〔6,400〕	13,600 〔7,400〕		6,700 〔3,700〕	8,000 〔4,400〕		2,700 〔1,500〕	3,500 〔1,900〕
NU-234	ICPエッチング装置 サムコ社製 RIE-200iPN	公開	可	3,100	5,900	7,000	3,100	4,300	5,200	3,100	3,100	3,800
			不可		8,400	10,000		6,100	7,400		4,300	5,400
		非公開	不可		18,500 〔10,100〕	22,000 〔12,000〕		13,500 〔7,400〕	16,400 〔9,000〕		9,500 〔5,200〕	11,900 〔6,500〕

マテリアル先端リサーチインフラ (ARIM) 事業共用機器の使用料設定について
(旧ナノテクノロジープラットフォーム事業 (微細加工) 分)

令和8年10月1日適用

I 1時間あたりの使用料

単位: 円、消費税込み [] 内は研究成果非公開使用料 (内数)

番号	共用機器種別	利用報告書	データ登録	依頼測定時 (技術代行)			直接測定時 (技術補助)			直接測定時		
				学内者	学外者		学内者	学外者		学内者	学外者	
					非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人
NU-235	超高密度大気圧プラズマ装置 富士機械製造 (株) 社製	公開	可	700	3,900	4,500	700	2,300	2,700	700	1,000	1,300
			不可		5,500	6,400		3,200	3,800		1,400	1,800
		非公開	不可		12,600 [7,100]	14,600 [8,200]		7,600 [4,400]	9,000 [5,200]		3,600 [2,200]	4,500 [2,700]
NU-236	In-situ 電子スピン共鳴 (ESR) Bruker 社製 EMX Premium X	公開	可	2,000	4,900	5,700	2,000	3,300	3,900	2,000	2,100	2,500
			不可		7,000	8,100		4,700	5,500		2,900	3,500
		非公開	不可		16,200 [9,200]	18,700 [10,600]		11,200 [6,500]	13,100 [7,600]		7,200 [4,300]	8,600 [5,100]
NU-237	ラジカル計測付多目的プラズマプロセス装置	公開	可	1,900	4,900	5,900	1,900	3,300	4,000	1,900	2,000	2,600
			不可		6,900	8,300		4,600	5,700		2,800	3,700
		非公開	不可		16,500 [9,600]	19,700 [11,400]		11,500 [6,900]	14,100 [8,400]		7,500 [4,700]	9,600 [5,900]
NU-238	高温プロセス用誘導結合型プラズマエッチング装置 NUシステム製 NU-RC/CI-Etch	公開	可	2,800	5,600	6,500	2,800	4,000	4,700	2,800	2,800	3,300
			不可		7,900	9,200		5,600	6,600		3,800	4,600
		非公開	不可		19,200 [11,300]	22,200 [13,000]		14,200 [8,600]	16,600 [10,000]		10,200 [6,400]	12,100 [7,500]
NU-239	表面解析プラズマビーム装置 NUシステム製 LIA-Plasma Beam/CF&Cl System	公開	可	3,800	6,300	8,400	3,800	4,700	6,600	3,800	3,800	5,200
			不可		9,000	12,000		6,700	9,400		4,900	7,400
		非公開	不可		23,000 [14,000]	30,000 [18,000]		18,000 [11,300]	24,400 [15,000]		14,000 [9,100]	19,900 [12,500]
NU-240	in-situ プラズマ照射表面分析装置	公開	可	2,900	5,600	7,000	2,900	4,000	5,200	2,900	2,900	3,800
			不可		8,000	10,000		5,700	7,400		3,900	5,400
		非公開	不可		20,400 [12,400]	25,200 [15,200]		15,400 [9,700]	19,600 [12,200]		11,400 [7,500]	15,100 [9,700]
NU-243	真空紫外吸収分光計 (原子ラジカルモニター) NUシステム社製	公開	可	2,900	5,700	6,500	2,900	4,100	4,700	2,900	2,900	3,300
			不可		8,100	9,200		5,800	6,600		4,000	4,600
		非公開	不可		17,900 [9,800]	20,300 [11,100]		12,900 [7,100]	14,700 [8,100]		8,900 [4,900]	10,200 [5,600]
NU-244	レーザ描画装置一式 Heidelberg 製 mPG101-UV	公開	可	3,100	5,900	6,900	3,100	4,300	5,100	3,100	3,100	3,700
			不可		8,400	9,800		6,100	7,200		4,300	5,200
		非公開	不可		20,300 [11,900]	23,600 [13,800]		15,300 [9,200]	18,000 [10,800]		11,300 [7,000]	13,500 [8,300]
NU-245	スパッタリング装置一式 キャノンアネルパ製 E-200S	公開	可	4,100	6,700	7,800	4,100	5,100	6,000	4,100	4,100	4,600
			不可		9,500	11,100		7,200	8,500		5,400	6,500
		非公開	不可		23,100 [13,600]	27,000 [15,900]		18,100 [10,900]	21,400 [12,900]		14,100 [8,700]	16,900 [10,400]
NU-246	超臨界乾燥機 KISCO 製 SCLEAD3CD2000	公開	可	700	4,000	4,700	700	2,400	2,900	700	1,200	1,500
			不可		5,700	6,700		3,400	4,100		1,600	2,100
		非公開	不可		12,900 [7,200]	15,100 [8,400]		7,900 [4,500]	9,500 [5,400]		3,900 [2,300]	5,000 [2,900]
NU-247	ナノインプリント装置一式 SCIVAX 製 X-300 BVU-ND	公開	可	1,800	5,000	6,000	1,800	3,400	4,200	1,800	2,100	2,800
			不可		7,100	8,500		4,800	5,900		3,000	3,900
		非公開	不可		16,100 [9,000]	19,300 [10,800]		11,100 [6,300]	13,700 [7,800]		7,100 [4,100]	9,200 [5,300]
NU-248	バリレンコーティング装置一式 KISCO 製 DACS-LAB	公開	可	500	3,900	4,500	500	2,300	2,700	500	1,000	1,300
			不可		5,500	6,400		3,200	3,800		1,400	1,800
		非公開	不可		12,100 [6,800]	14,100 [7,700]		7,100 [3,900]	8,500 [4,700]		3,100 [1,700]	4,000 [2,200]

マテリアル先端リサーチインフラ (ARIM) 事業共用機器の使用料設定について
(旧ナノテクノロジープラットフォーム事業 (微細加工) 分)

令和8年10月1日適用

I 1時間あたりの使用料

単位: 円、消費税込み []内は研究成果非公開使用料 (内数)

番号	共用機器種別	利用報告書	データ登録	依頼測定時 (技術代行)			直接測定時 (技術補助)			直接測定時		
				学内者	学外者		学内者	学外者		学内者	学外者	
					非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人
NU-250	マスクアライナー式 (2) Suss MicroTec AG製 MJB-3	公開	可	1,300	4,600	5,400	1,300	3,000	3,600	1,300	1,700	2,200
			不可		6,500	7,700		4,200	5,100		2,400	3,100
		非公開	不可		14,300 [7,800]	16,900 [9,200]		9,300 [5,100]	11,300 [6,200]		5,300 [2,900]	6,800 [3,700]
NU-251	マスクアライナー式 (3) ナノテック製 LA410	公開	可	1,100	4,500	5,300	1,100	2,900	3,500	1,100	1,700	2,100
			不可		6,400	7,500		4,100	4,900		2,300	2,900
		非公開	不可		14,100 [7,700]	16,500 [9,000]		9,100 [5,000]	10,900 [6,000]		5,100 [2,800]	6,400 [3,500]
NU-253	SEM用断面試料作製装置 JEOL製 SM-09010	公開	可	700	4,100	4,700	700	2,500	2,800	700	1,200	1,400
			不可		5,800	6,600		3,500	4,000		1,700	2,000
		非公開	不可		12,800 [7,000]	14,500 [7,900]		7,800 [4,300]	8,900 [4,900]		3,800 [2,100]	4,400 [2,400]
NU-254	デジタルマイクロSCOPE式 KEYENCE製 VK-9700	公開	可	1,000	4,200	4,900	1,000	2,600	3,100	1,000	1,400	1,700
			不可		6,000	7,000		3,700	4,400		1,900	2,400
		非公開	不可		13,200 [7,200]	15,400 [8,400]		8,200 [4,500]	9,800 [5,400]		4,200 [2,300]	5,300 [2,900]
NU-255	デジタルマイクロSCOPE式 KEYENCE製 VK-9510	公開	可	800	4,000	4,600	800	2,400	2,800	800	1,100	1,400
			不可		5,600	6,500		3,300	3,900		1,500	1,900
		非公開	不可		12,300 [6,700]	14,300 [7,800]		7,300 [4,000]	8,700 [4,800]		3,300 [1,800]	4,200 [2,300]
NU-256	Deep Si Etcher 住友精密工業製 Multiplex-ASE	公開	可	8,900	10,500	12,600	8,900	8,900	10,800	8,900	8,900	9,400
			不可		15,000	17,900		12,700	15,300		10,900	13,300
		非公開	不可		33,100 [18,100]	39,500 [21,600]		28,100 [15,400]	33,900 [18,600]		24,100 [13,200]	29,400 [16,100]
NU-257	露光プロセス装置一式 ユニオン光学社製 PEM800	公開	可	800	4,000	4,700	800	2,400	2,900	800	1,100	1,500
			不可		5,600	6,700		3,300	4,100		1,500	2,100
		非公開	不可		12,300 [6,700]	14,700 [8,000]		7,300 [4,000]	9,100 [5,000]		3,300 [1,800]	4,600 [2,500]
NU-258	フーリエ変換赤外分光分析装置 日本分光社製 FT/IR-615V型	公開	可	1,100	4,200	5,100	1,100	2,600	3,300	1,100	1,400	1,900
			不可		6,000	7,200		3,700	4,600		1,900	2,600
		非公開	不可		13,200 [7,200]	15,800 [8,600]		8,200 [4,500]	10,200 [5,600]		4,200 [2,300]	5,700 [3,100]
NU-259(1)	磁気特性評価システム (1) 交番磁界勾配型磁力計	公開	可	1,300	4,400	5,200	1,300	2,800	3,300	1,300	1,500	1,900
			不可		6,200	7,300		3,900	4,700		2,100	2,700
		非公開	不可		13,700 [7,500]	16,100 [8,800]		8,700 [4,800]	10,500 [5,800]		4,700 [2,600]	6,000 [3,300]
NU-259(2)	磁気特性評価システム (5) 振動試料型磁力計 TM-VSM271483-HGC	公開	可	1,300	4,500	5,300	1,300	2,800	3,500	1,300	1,600	2,100
			不可		6,300	7,500		4,000	4,900		2,200	2,900
		非公開	不可		13,900 [7,600]	16,500 [9,000]		8,900 [4,900]	10,900 [6,000]		4,900 [2,700]	6,400 [3,500]
NU-259(3)	磁気特性評価システム (3) トルク磁力計	公開	可	1,000	4,200	4,900	1,000	2,600	3,100	1,000	1,400	1,700
			不可		6,000	7,000		3,700	4,400		1,900	2,400
		非公開	不可		13,200 [7,200]	15,400 [8,400]		8,200 [4,500]	9,800 [5,400]		4,200 [2,300]	5,300 [2,900]
NU-259(4)	磁気特性評価システム (4) 磁気光学スペクトロメータ	公開	可	1,200	4,300	5,200	1,200	2,700	3,400	1,200	1,400	2,000
			不可		6,100	7,400		3,800	4,800		2,000	2,800
		非公開	不可		13,400 [7,300]	16,300 [8,900]		8,400 [4,600]	10,700 [5,900]		4,400 [2,400]	6,200 [3,400]
NU-260	マスクレス露光装置 ネオアーク製 PALET DDB-701-DL4	公開	可	1,300	4,500	5,200	1,300	2,800	3,300	1,300	1,600	1,900
			不可		6,300	7,300		4,000	4,700		2,200	2,700
		非公開	不可		13,900 [7,600]	16,100 [8,800]		8,900 [4,900]	10,500 [5,800]		4,900 [2,700]	6,000 [3,300]

マテリアル先端リサーチインフラ (ARIM) 事業共用機器の使用料設定について
(旧ナノテクノロジープラットフォーム事業 (微細加工) 分)

令和8年10月1日適用

I 1時間あたりの使用料

単位: 円、消費税込み [] 内は研究成果非公開使用料 (内数)

番号	共用機器種別	利用報告書	データ登録	依頼測定時 (技術代行)			直接測定時 (技術補助)			直接測定時		
				学内者	学外者		学内者	学外者		学内者	学外者	
					非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人		非営利法人	営利法人
NU-261	段差計 小坂研究所製 ET200A	公開	可	1,100	4,200	4,900	1,100	2,600	3,100	1,100	1,400	1,700
			不可		6,000	6,900		3,700	4,300		1,900	2,300
		非公開	不可		13,200 〔7,200〕	15,200 〔8,300〕		8,200 〔4,500〕	9,600 〔5,300〕		4,200 〔2,300〕	5,100 〔2,800〕
NU-262	プラズマ誘起CVD装置 サムコ社製 PD-220N	公開	可	4,200	6,800	8,000	4,200	5,200	6,100	4,200	4,200	4,700
			不可		9,700	11,300		7,400	8,700		5,600	6,700
		非公開	不可		21,400 〔11,700〕	24,900 〔13,600〕		16,400 〔9,000〕	19,300 〔10,600〕		12,400 〔6,800〕	14,800 〔8,100〕
NU-263	高分解能走査型電子顕微鏡 日本電子製 JSM-IT800SHL	公開	可	1,500	4,500	5,400	1,500	2,900	3,600	1,500	1,700	2,200
			不可		6,400	7,700		4,100	5,100		2,300	3,100
		非公開	不可		15,400 〔9,000〕	18,500 〔10,800〕		10,400 〔6,300〕	12,900 〔7,800〕		6,400 〔4,100〕	8,400 〔5,300〕
NU-264	原子間力顕微鏡 パーク・システムズ社製 NX20	公開	可	1,300	4,400	5,200	1,300	2,800	3,300	1,300	1,500	1,900
			不可		6,200	7,300		3,900	4,700		2,100	2,700
		非公開	不可		15,000 〔8,800〕	17,600 〔10,300〕		10,000 〔6,100〕	12,000 〔7,300〕		6,000 〔3,900〕	7,500 〔4,800〕
NU-265	物理特性測定装置 日本カンタム・デザイン社製 DynaCool-12T () 内は1日あたりの料金	公開	可	2,300 (18,400)	5,200 (41,600)	6,100 (48,800)	2,300 (18,400)	3,500 (28,000)	4,300 (34,400)	2,300 (18,400)	2,300 (18,400)	2,900 (23,200)
			不可		7,300 (58,400)	8,700 (69,600)		5,000 (40,000)	6,100 (48,800)		3,200 (25,600)	4,100 (32,800)
		非公開	不可		17,500 〔10,200〕 (140,000) 〔(81,600)〕	20,700 〔12,000〕 (165,600) 〔(96,000)〕		12,500 〔7,500〕 (100,000) 〔(60,000)〕	15,100 〔9,000〕 (120,800) 〔(72,000)〕		8,500 〔5,300〕 (68,000) 〔(42,400)〕	10,600 〔6,500〕 (84,800) 〔(52,000)〕
NU-266	全自動X線回折装置 リガク製 SmartLab 9kW	公開	可	1,700	4,700	5,600	1,700	3,100	3,800	1,700	1,900	2,400
			不可		6,700	8,000		4,400	5,400		2,600	3,400
		非公開	不可		16,000 〔9,300〕	18,900 〔10,900〕		11,000 〔6,600〕	13,300 〔7,900〕		7,000 〔4,400〕	8,800 〔5,400〕
NU-267	RIEエッチング装置 サムコ社製 RIE-10NR	公開	可	1,900	4,900	5,700	1,900	3,300	3,900	1,900	2,000	2,500
			不可		6,900	8,100		4,600	5,500		2,800	3,500
		非公開	不可		16,200 〔9,300〕	18,900 〔10,800〕		11,200 〔6,600〕	13,300 〔7,800〕		7,200 〔4,400〕	8,800 〔5,300〕
NU-268	電子線描画用データ処理ソフトウェア GenISys社製 BEAMER	公開	可	1,700	4,700	5,400	1,700	3,100	3,600	1,700	1,900	2,200
			不可		6,700	7,700		4,400	5,100		2,600	3,100
		非公開	不可		14,800 〔8,100〕	16,900 〔9,200〕		9,800 〔5,400〕	11,300 〔6,200〕		5,800 〔3,200〕	6,800 〔3,700〕
NU-269	イオンビームエッチング装置 伯東製 10IBE-EPD-SS	公開	可	2,600	5,600	6,700	2,600	4,000	4,900	2,600	2,700	3,400
			不可		7,900	9,500		5,600	6,900		3,800	4,800
		非公開	不可		19,300 〔11,400〕	23,100 〔13,600〕		14,200 〔8,600〕	17,400 〔10,500〕		10,200 〔6,400〕	12,700 〔7,900〕

★研究成果非公開使用料は、共用機器1時間あたりのオプション料金 (加算額)
☆上記共用機器使用料は、文部科学省「マテリアル先端リサーチインフラ事業」の採択により軽減されております。
事業終了後は、通常の料金設定となります。

II 算出内訳 別紙1のとおり

III 項目別算出基礎 別紙2のとおり

IV 解析手数料 (1時間当たり)

単位: 円、消費税込み

解析手数料	学内者	学外者	
		非営利法人	営利法人
		5,900	6,600

V 算出基礎 別紙3のとおり